

アルバック・ファイ 技術講演会 — 半導体を支える分析計測技術 —

7/10 FRI 13:00~17:00 (受付開始 12:30)

【会場】品川 THE GRAND HALL 〒108-0075 東京都港区港南 2-16-4
品川グランドセントラルタワー 3 階

※例年と開催会場が異なります。

※どなたでもご参加可能ですが、事前のご登録が必要です。

インフォマインテリジェンス合同会社
シニア コンサルティングディレクター

南川 明 様

『2026年以降の電子機器・半導体の新たな成長シナリオ』

本講演では、米中対立が電子機器・半導体産業へ与える影響や、AIビジネスの成長シナリオ、日本政府の考え方と日本企業の成長戦略について解説する。特に、2026年から2030年頃までの市場動向や技術変化を見据え、日本企業が取るべき戦略を考察する。また、AIビジネスが仕事や生活に与える影響について触れ、2030年以降を見据えた新たな成長シナリオについて展望する。

トヨタ自動車株式会社 先進データサイエンス統括部
WAVEBASE プロジェクト プロジェクト長

庄司 哲也 様

『WAVEBASEが拓く材料開発DX ——多次元分析データを活かし切る新しい開発フロー』

本講演では、材料データ活用基盤WAVEBASEの概要について、プロジェクト立ち上げの背景から紹介する。多次元の材料分析データを汎用的に特徴量化するコア技術により、機械学習への活用を可能とし、人の判断根拠を残したままデータを再利用できる点について解説する。さらに、活用事例としてアルバック・ファイのOLED TOF-SIMSデータ解析を取り上げ、WAVEBASEによるデータ活用の可能性と今後の展望を紹介する。

YKK 株式会社 常務執行役員

テクノロジー・イノベーションセンター 技術戦略推進室長

喜多 和彦 様

『YKKにおける機器分析の活用』

本講演では、YKKにおける機器分析の活用について紹介する。分析技術の活用方法や人材育成への取り組みに加え、メーカーが自ら機器分析装置を保有する目的や意義について解説する。さらに、YKKグループにおける具体的な分析結果や活用事例を通して、機器分析が製品開発や品質向上に果たす役割について紹介する。

Physical Electronics President

Dr. Kateryna Artyushkova

『Analysis of Interfaces by Soft and Hard X-ray Photoemission』